

化学的気相成長装置のための多加熱帯 Cvd の管状炉機械

商品番号: KT-CTF14



前書き

KINTEKのマルチゾーンCVD管状炉は、高度な薄膜蒸着用の精密温度制御を提供します。研究および生産に最適で、ラボのニーズに合わせてカスタマイズ可能です。

[詳細を学ぶ](#)

炉型	KT-CTF14-60
最高温度	1400°C
一定作業温度	1300°C
炉管材質	高純度Al2O3管
炉管の直径	60mm
加熱ゾーン	2x450mm
チャンバー材質	アルミナ多結晶ファイバー
発熱体	炭化ケイ素
加熱速度	0~10°C/分
熱電対	Sタイプ
温度コントローラー	デジタルPIDコントローラー/タッチスクリーンPIDコントローラー
温度制御の正確さ	±1°C
ガス精密制御ユニット	
流量計	MFCマスフローメーター
ガスチャンネル	4チャンネル
流量	MFC1: 0-5SCCM O2 MFC2: 0-20SCMCH4 mfc3: 0- 100sccm h2 mfc4: 0-500sccm n2
直線性	±0.5% F.S.
繰り返し性	±0.2% F.S.
パイプラインとバルブ	ステンレス鋼
最高使用圧力	0.45MPa
流量計コントローラー	デジタルノブコントローラー/タッチスクリーンコントローラー

標準真空ユニット（オプション）

真空ポンプ	ロータリーベーン真空ポンプ
ポンプ流量	4L/S
真空吸引ポート	KF25
真空計	ピラニ/抵抗シリコン真空計
定格真空圧	10Pa

高真空ユニット（オプション）

真空ポンプ	ロータリーベーンポンプ+分子ポンプ
ポンプ流量	4L/S+110L/S
真空吸引ポート	KF25
真空計	複合真空計
定格真空圧	6x10 ⁻⁵ Pa

上記の仕様とセットアップはカスタマイズすることができます

いいえ	内容	数量
1	炉	1
2	石英管（または注文に応じた他の材料）	1
3	真空フランジセット	2
4	チューブサーマルブロック	2
5	チューブサーマルブロックフック	1
6	耐熱グローブ	1
7	精密ガス制御ユニット（注文の場合）	1
8	真空ユニット（注文の場合）	1
9	取扱説明書	1